

自动压力研磨抛光机说明书

UNIPOL-1200D



天津品创科技发展有限公司

产品简介

UNIPOL-1200D 双盘压力研磨抛光机主要用于材料研究领域，广泛使用于大专院校、科研院所实验室的金属、陶瓷、玻璃、岩样、矿样等材料样品的自动研磨抛光，以及工厂的小规模生产等。本机设有两个研磨抛光工位，可以分别进行研磨、抛光操作，既避免了交叉污染，又提高了工作效率。

主要特点

- 1、设有两个研磨抛光工位，可分别进行研磨、抛光操作。
- 2、中心加载压力，压力稳定可靠。
- 3、性能优良，操作简单，适用范围广。

技术参数

型号	UNIPOL-1200M		
电源	220V 50Hz		
载物盘	Φ 150mm		
桃型孔	Φ 25. 4mm		
磨抛盘	Φ 300mm		
载物盘（上盘）转速	10rpm-80rpm（无级调速）		
磨抛盘（下盘）转速	50rpm-400rpm（增量调速，最小增量 10）		
压力	0. 5-20kg（最小增量 0. 5kg）		
标准配件	1	铸铝盘	2 个
	2	平载物盘	1 个
	3	桃型孔载物盘	1 个
	4	磁力片	4 片
	5	研抛底片	6 片
	6	砂纸（240#、400#、800#、1500#）	各 2 片
	7	抛光垫（磨砂革、合成革、聚氨酯）	各 2 片
可选配件	1	SKZD-2 滴料器	
	2	SKZD-3 滴料器	
	3	YJXZ-12 搅拌循环泵	
	4	“00” 级精密测厚仪	
	5	GPC-50 精确磨抛控制仪	
	6	陶瓷研磨盘	
	7	玻璃研磨盘	
	8	研磨膏（W2. 5）	
产品规格	880mm×660mm×800mm		
重量	105kg		



品创科技

TIANJIN17.COM

电话：022-87938642

传真：022-87938643